

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4639048号
(P4639048)

(45) 発行日 平成23年2月23日(2011.2.23)

(24) 登録日 平成22年12月3日(2010.12.3)

(51) Int. Cl.		F I		
GO 1 R 1/073 (2006.01)		GO 1 R 1/073		D
GO 1 R 31/26 (2006.01)		GO 1 R 31/26		J

請求項の数 4 (全 11 頁)

(21) 出願番号	特願2003-584742 (P2003-584742)	(73) 特許権者	000004640 日本発條株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目10番地
(86) (22) 出願日	平成15年4月16日(2003.4.16)	(74) 代理人	100089266 弁理士 大島 陽一
(86) 国際出願番号	PCT/JP2003/004839	(72) 発明者	風間 俊男 長野県上伊那郡宮田村3131番地 日本 発條株式会社内
(87) 国際公開番号	W02003/087854		
(87) 国際公開日	平成15年10月23日(2003.10.23)		
審査請求日	平成17年11月17日(2005.11.17)		
審査番号	不服2008-22011 (P2008-22011/J1)		
審査請求日	平成20年8月28日(2008.8.28)		
(31) 優先権主張番号	特願2002-113691 (P2002-113691)		
(32) 優先日	平成14年4月16日(2002.4.16)	合議体	
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	審判長	下中 義之
		審判官	大熊 靖夫
		審判官	飯野 茂

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性接触子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

導電性接触子であって、
厚さ方向に貫通する複数のホルダ孔(2)を有するホルダ部材(3, 4, 5)と、
前記各ホルダ孔に受容された導電性コイルばね(8)と、
前記コイルばねの両軸線方向端に設けられた一对の導電性接触部材(9, 10)と、
前記一对の導電性接触部材の一方が前記ホルダ孔から抜け落ちることのないように、前記各ホルダ孔に設けられた係合部(2a, 2b)とを有し、
前記ホルダ部材には前記一对の導電性接触部材の他方を当接させる配線板(11)が取り付けられ、

前記コイルばねは密着巻き部(8a)と粗巻き部(8b)とを有し、前記密着巻き部が前記一对の導電性接触部材のいずれか一方に結合され、前記粗巻き部が前記一对の導電性接触部材のいずれか他方に結合され、

前記一对の導電性接触部材と前記コイルばねとを前記ホルダ孔に前記コイルばねの無負荷状態で組み付けた状態に於いて、前記一对の導電性接触部材の一方の前記係合部に当接する位置から前記一对の導電性接触部材の他方の先端までの長さ(L)と、前記ホルダ孔における前記一对の導電性接触部材の他方と前記コイルばねとを収める部分の深さ(D)とが同一になるように設定され、かつ前記密着巻き部の前記粗巻き部側端部に前記一对の導電性接触部材の前記粗巻き部が結合された方の軸部(10c)の突出端部が軸線方向に対して重なっていることを特徴とする導電性接触子。

10

20

【請求項 2】

前記各コイルばねの両軸線方向端に設けられた前記接触部材が針状体をなすことを特徴とする請求項 1 に記載の導電性接触子。

【請求項 3】

前記係合部が、前記各ホルダ孔内に画定された肩面を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の導電性接触子。

【請求項 4】

導電性接触子であって、
厚さ方向に貫通する複数のホルダ孔(2)を有するホルダ部材(3, 4, 5)と、
前記各ホルダ孔に受容された導電性コイルばね(8)と、
前記コイルばねの一方の軸線方向端に設けられた導電性針状体(9)と、
前記コイルばねの他方の軸線方向端からなる導電性接触部材(8c)と、
前記針状体が前記ホルダ孔から抜け落ちることのないように、前記各ホルダ孔に設けられた係合部(2a, 2b)とを有し、

前記ホルダ部材には前記導電性接触部材を当接させる配線板(11)が取り付けられ、
前記コイルばねは、前記導電性針状体に結合される密着巻き部(8a)と、前記密着巻き部と前記導電性接触部材との間に設けられた粗巻き部(8b)とを有し

前記導電性針状体と前記コイルばねとを前記ホルダ孔に前記コイルばねの無負荷状態で組み付けた状態に於いて、前記導電性針状体の前記係合部に当接する位置から前記導電性接触部材の先端までの長さ(L)と、前記ホルダ孔の前記コイルばねを収める部分の深さ(D)とが同一になるようにされていることを特徴とする導電性接触子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、導電性接触子に関し、特に、高密度に配置されたアクセスされるべき点を有する高集積半導体素子、その他の検査対象を試験するのに適する導電性接触子に関する。

【背景技術】

【0002】

この種の導電性接触子は、厚さ方向に貫通する複数のホルダ孔を有する板部材をなすホルダ部材と、各ホルダ孔に受容された導電性コイルばねと、コイルばねの両軸線方向端に設けられた一对の針状体とを有する。この種の導電性接触子は、通常、検査対象と試験装置の回路基板との間に於いて用いられる。

【0003】

両可動端を有する導電性接触子の場合、各コイルばねについて設けられた2つの針状体は、ホルダに設けられた肩面などにより、ある程度以上に抜け出さないようにしている。一方のみが可動端をなすような導電性接触子の場合、針状体の一方は同様に抜け止めされ、針状体の他方は、ホルダの対応する側に取付けられた回路基板のパッドに衝当するようになっている。

【0004】

いずれにせよ、各コイルばねから所要の弾発力を得るために、各コイルばねは予圧縮した状態で組み込まれる。そうすることにより、対応する針状体の没入ストロークに関わらず、弾発力があまり変化することのないようにしている。

【0005】

しかしながら、発明者の知見によれば、各導電性接触子の(それぞれ導電性コイルばねと一对の針状体とを有する)接触ユニットの数が、近代的な半導体素子に於ける高密度に配置された端子或いはパッドに適合するように増大するにつれて、導電性接触子のコイルばねの全体としてのばね力が増大し、導電性接触子のホルダの強度を確保するのが困難になってきている。各接触ユニットは、極めて小型であることから、各コイルばねのばね力が小さいが、最新型の半導体素子を検査するための導電性接触子によっては、接触ユニットの数があまりにも膨大であることから、全体としてのばね力が極めて大きくなる。

【0006】

特に、両導電性針状体の少なくとも一方がホルダ孔から抜け落ちることのないように、ホルダ孔等に設けられた肩面などにより抜け止めされていることから、このような肩面などは常時コイルばねの予圧縮力を受けることになる。即ち、全体としてのばね力が肩面に作用し、ホルダの一部を他の部分から押し離すように作用する。

【0007】

そのようなコイルばねの圧縮荷重が大きい場合には、通常複数の層をなす支持体からなるホルダには、そのような圧縮荷重が作用し、変形して支持体に反りやたわみが生じる場合がある。そのような場合、針状体の先端位置（接触位置）の精度が悪化するという問題や、針状体の動作を悪くするという問題がある。なお、支持体を厚くすれば強度を確保す

10

【0008】

しかしながら、検査対象の信号の高周波数化に伴い、導電性接触子にも高周波数化された検査信号を通し得るようにする必要があり、そのためには、全長（信号が通る線路長）を短くすると良いが、ホルダを薄型化することは支持体の厚さ（導電性接触子の軸線方向長さ）を薄くすることになる。支持体が薄くなるとその強度が低下してしまうため、上記問題が解決されない。

【0009】

また、半導体関連部品の検査において、高温雰囲気（約150度）下で電圧を印加して長時間（数時間～数十時間）テストするバーンインテストを行う場合には、熱膨張の小さな絶縁材料である例えばセラミックスを使用することが望ましいが、支持体がセラミックスのような脆い材質のものであると、ばね荷重が大きいと支持体が破壊される虞があり、薄型化を要求される導電性接触子の支持体をセラミックス製とすることが難しいという問題がある。また、常温雰囲気で使用されるものでは支持体に合成樹脂材料を用いることができるが、その場合には荷重により支持体に変形するという問題がある。

20

【発明の開示】

【0010】

このような従来技術の課題に鑑み、本発明の主な目的は、高密度に配置されたアクセスされるべき点を有する高集積半導体素子、その他の検査対象を試験するのに適する導電性接触子を提供することにある。

30

【0011】

本発明の第2の目的は、構造が単純で、経済的に製造可能な導電性接触子を提供することにある。

【0012】

本発明の第3の目的は、極めて薄型化が可能な導電性接触子を提供することにある。

【0013】

本発明の第3の目的は、機械的には必ずしも良好でない特性を有するが、その他の特性に於いて優れた材料からなるホルダを用いた導電性接触子を提供することにある。

【0014】

このような目的は、本発明によれば、導電性接触子であって、厚さ方向に貫通する複数のホルダ孔（2）を有するホルダ部材（3, 4, 5）と、前記各ホルダ孔に受容された導電性コイルばね（8）と、前記コイルばねの両軸線方向端に設けられた一对の導電性接触部材（9, 10）と、前記一对の導電性接触部材の一方が前記ホルダ孔から抜け落ちることのないように、前記各ホルダ孔に設けられた係合部（2a, 2b）とを有し、前記ホルダ部材には前記一对の導電性接触部材の他方を当接させる配線板（11）が取り付けられ、前記コイルばねは密着巻き部（8a）と粗巻き部（8b）とを有し、前記密着巻き部が前記一对の導電性接触部材のいずれか一方に結合され、前記粗巻き部が前記一对の導電性接触部材のいずれか他方に結合され、前記一对の導電性接触部材と前記コイルばねとを前記ホルダ孔に前記コイルばねの無負荷状態で組み付けた状態に於いて、前記一对の導電性接触部材の一方の前記係合部に当接する位置から前記一对の導電性接触部材の他方の先端

40

50

までの長さ(L)と、前記ホルダ孔における前記一对の導電性接触部材の他方と前記コイルばねとを収める部分の深さ(D)とが同一になるように設定され、かつ前記密着巻き部の前記粗巻き部側端部に前記一对の導電性接触部材の前記粗巻き部が結合された方の軸部(10c)の突出端部が軸線方向に対して重なっていることを特徴とする導電性接触子を提供することにより達成される。

【0015】

これによれば、コイルばね及び導電性接触部材のホルダへの組み付け状態でコイルばねが略無負荷状態であることから、ホルダ孔により一方の導電性接触部材を抜け止めする場合に、その抜け止め部にコイルばねの圧縮荷重が作用することがない。したがって、ホルダの厚さを薄くしても、従来例で示したような反りやたわみが生じることを回避でき、また熱膨張の小さな絶縁材料である例えばセラミックスを使用することができる。

10

【0016】

各コイルばねの両軸線方向端に設けられた前記接触部材は針状体をなすものであって良い。そのような場合、前記各ホルダ孔の一端のみに係合部が設けられ、対応する前記針状体が前記ホルダ孔から抜け落ちることのないようにすることができる。その場合、前記係合部が、前記各ホルダ孔内に画定された肩面を含むものであって良い。

【0017】

本発明の好適実施例によれば、前記各コイルばねの一方の軸線方向端に設けられた前記接触部材が針状体をなし、前記各コイルばねの他方の軸線方向端に設けられた前記接触部材が、該コイルばねのコイル端をなし、前記係合部により、前記両接触部材の一方のみが前記ホルダ孔から抜け落ちることのないようにされている。これによれば、部品点数及び組み立て工数を削減でき、製造コストを低廉化し得る。

20

【0018】

通常、ホルダの片側には試験装置の回路基板が取り付けられ、対応する側の接触部材が回路基板のパッドに当接する。従って、このような接触部材については、各ホルダ孔に抜け止めの係合部を設ける必要がない。このように係合部が設けられていない側の接触部材の遊端を、ホルダ部材の外面と概ね同一面をなすように設ければ、ホルダへの組み付け状態でホルダ外面からの接触部材の突出量を検査することにより、組み付けの良否を容易に確認することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

30

【0019】

図1は、本発明が適用された導電性接触子ユニットに用いられる導電性接触子用ホルダの平面図である。なお、検査対象が例えば8インチ・ウェハの場合には、本ホルダ1の大きさは、直径8インチ(約200mm)前後の図に示されるような円形板状であって良い。また8インチ・ウェハの場合には、その面積の中に数十個~数百個の半導体チップが形成されている。さらに、12インチ(約300mm)・ウェハの場合には数千個の半導体チップが形成される。

【0020】

図1に示されている導電性接触子用ホルダ1にあっては、上記したように検査対象のウェハと同様に平面視で円板形に形成されており、従来例で示したようにウェハに形成された複数のチップの各電極にそれぞれ対応する位置に複数の導電性接触子用のホルダ孔2が設けられている。なお、図では、ホルダ孔2の形状は誇張して示されており、その数も少ない。

40

【0021】

図2は、本発明が適用された導電性接触子ユニットの1例を示す要部縦断面図であり、図1の矢印II-II線に沿って見た断面に対応する。この図2のものでは、例えば図1の平面視で同一外形の3枚の支持体3・4・5を上層・中間層・下層として配置して、3層構造の導電性接触子用ホルダを構成したものである。

【0022】

各支持体3・4・5は、それぞれ同一材質からなるものであって良く、例えばホルダ孔

50

2を高精度に加工し得る合成樹脂製や、耐熱性に有効なセラミックス製とすることができる。なお、各支持体3・4・5は、それぞれ同一形状の円板状に形成され、例えば図示されないねじを用いて図2の積層状態に固定されている。積層状態の固定にねじを用いるのは、メンテナンスなどの分解組み立てを容易にするためである。

【0023】

図2及び図3に示されるように、支持体3には小径孔2aと大径孔2bとを同軸的に設けた段付き孔が形成されており、他の各支持体4・5には大径孔2bと同一径のストレート孔(2b)が形成されている。これら段付き孔(2a・2b)及び各ストレート孔(2b)によりホルダ孔2が形成されている。

【0024】

また、図3に示されるように、導電性接触子の導体部分は、導電性コイルばね8と、その両端部にそれぞれを互いに相反する向きに先端を向けて設けられた一对の導電性接触手段としての導電性針状体9・10とからなる。一方(図における下側)の導電性針状体9には、図の下方に先鋭端を向けた針状部9aと、針状部9aよりも拡径されたフランジ部9bと、フランジ部9bに対して針状部9aとは相反する側(図の上方)に突設されたボス部9cとがそれぞれ同軸的に形成されている。他方(図における上側)の針状体10には、図の上方に先鋭端を向けた針状部10aと、針状部10aよりも小径のボス部10bと、ボス部10bに対して針状部10aとは相反する側(図の下方)に突設された軸部10cとがそれぞれ同軸的に形成されている。

【0025】

コイルばね8には、図3における下側部分に密着巻き部8aが形成され、上側部分に粗巻き部8bが形成されている。その密着巻き部8aによるコイル端部に一方の針状体9のボス部9cが嵌合し、粗巻き部8bによるコイル端部に他方の針状体10のボス部10bが嵌合するようになっている。このコイルばね8の各ボス部9b・10cとの嵌合は、ばねの巻き付き力によるものとしたり、さらに半田付けしたりしても良い。なお、半田付けの場合には、コイルばね8と各ボス部9b・10cとが多少緩い状態であっても良い。

【0026】

また、図3に示されるコイルばね8と一对の導電性針状体9・10との組み付け状態にあっては、コイルばね8の自然長(無負荷)状態で密着巻き部8aの粗巻き部8b側端部に他方の導電性針状体10の軸部10cの突出端部が軸線方向に対して重なるようになっていると良い。これにより、検査時の圧縮状態でコイルばね8が湾曲することにより密着巻き部8aと軸部10cとが接触し、両導電性針状体9・10間を通る電気信号が、密着巻き部8aと軸部10cとを通過して、粗巻き部8aを通過することを回避される。これにより、両導電性針状体9・10の軸線方向にすなわち直線的に電気信号が流れ、近年の高周波数化されたチップの検査に対応し得る。

【0027】

そして、図3の矢印に示されるように、互いに一体化されたコイルばね8及び一对の導電性針状体9・10をホルダ孔2に挿入して、支持体(1・3・4)に組み付ける。例えば、実際の使用にあっては、図2に示されるように図3とは天地を逆にする場合がある。そのような場合であっても、コイルばね8及び導電性針状体9・10の組み付け時には図3に示されるようにすることにより、一方の導電性針状体9のフランジ部9bが小径孔2a及び大径孔2bによる段部に当接して、コイルばね8及び針状体9・10が抜け止めされる。これら小径孔2a及び大径孔2bによる段部とフランジ部9bとにより抜け止め部が構成されている。

【0028】

そして、図2の組み付け状態にあっては、ホルダ孔2の段付き孔側を上にして、ホルダ孔2のストレート孔側を下にして、その下側に検査装置側の配線板11を例えばねじ止めしてセットしている。その配線板11には、導電性針状体10に対応する位置に各端子11aが配設されており、図2の組み付け状態で導電性針状体10の針状部10aが端子11aに当接して、それによりストレート孔側を下にした状態におけるコイルばね8及び導

10

20

30

40

50

電性針状体 9・10 が抜け止めされている。

【0029】

本発明によれば、この図2の組み付け状態において、針状体10の針状部10aの先端が、配線板11の端子11aに接触するか接触しない位置、すなわちコイルばね8が略無負荷状態になる位置にある。例えば、上記した図3に示されるコイルばね8及び針状体9・10が一体化されたものにおいて、コイルばね8の略無負荷状態で、フランジ部9bから針状部10aの先端までの長さLと、ホルダ1の大径孔2bの深さDとを、概ね同一になるようにそれぞれ設定する。

【0030】

上記したようにホルダ1にセットした配線板11の端子11aがホルダ1の図2における下面と同一面上に位置することにより、フランジ部9bから針状部10aの先端までの部分が大径孔2bの深さD内に収められることになるが、上記したように長さLと深さDとが概ね同一であることから、コイルばね8に大きな圧縮荷重が発生しない。これにより、支持体3がコイルばね8のばね力により押し上げられることがなく、支持体3を例えば1mm程度まで薄型化しても、従来例で示したような反りやたわみが生じることを回避できる。また、大型(200~300mmの直径)のホルダの支持体として使用可能である。

【0031】

なお、全数の針状部10aの先端が大径孔2b内に収まるようにしても良い。その場合には、コイルばね8との結合誤差による上記長さLのばらつきによる影響を受けないように、針状体9の針状部9aの突出量の長さを上記ばらつき分を吸収し得る長さを含んだ長さ

【0032】

また、支持体3を薄型化でき、かつ熱膨張の小さな絶縁材料である例えばセラミックスを支持体3の材料として使用することができる。セラミックスは脆い材料であるが、本構造により、支持体3にクラックや割れや欠けなどが発生することを回避できる。他の支持体4・5も同様の材質にすることにより、高温雰囲気(約150度)下で電圧を印加して長時間(数時間~数十時間)テストするバーンインテストを行うための導電性接触子として何ら問題なく使用できる。

【0033】

また、上記長さLと深さDとの関係は、ホルダ1へのコイルばね8及び針状体9・10の組み付け状態で、針状部10aのホルダ1外方(配線板11側)への突出量をできるだけ小さくするか、接触するかしないか位に引っ込んだ程度にすると良い。配線板11をセットした状態で端子11aに針状部10aが押圧しても、その押圧力(ばね荷重)ができるだけ小さくなるようにすることが望ましい。これにより、ホルダ1への組み付け状態でホルダ外面からの突出量を検査することにより、不良品を容易に見付けることができ、コイルばね8及び針状体9・10の長さの良否を容易に確認することができる。

【0034】

なお、図2に示されるように、その上側の導電性針状体9の針状部9aが上方に突出しており、検査対象のウェハ26に向けて導電性接触子ユニットを図の矢印に示されるように近づけることにより、各電極26aに対して各針状部9aが当接し、各針状部9a及び各針状部10aがそれぞれ各電極26a及び各端子11aに弾発的に当接する。このようにして導電性接触子を介して、ウェハ26に対する所定の電氣的検査を行うことができる。この状態では配線板11とウェハ26とにコイルばね8のばね荷重が作用するだけであり、各支持体3・4・5にはばね荷重は作用しない。

【0035】

また、上記図示例では、導電性接触子用ホルダを、3枚の支持体3・4・5による3層構造としたが、ホルダ孔2の孔径やピッチの大きさにより、1枚で構成しても良い。その1枚構成の例を図4に示す。なお、図4の支持体1にあっては、上記図示例の支持体1と同様であって良く、同様の部分には同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。

【0036】

図4に示される導電性接触子用ホルダにあっては、1枚の支持体1の段付き形状のホルダ孔2内に、コイルばね8及び一对の導電性針状体9・10が受容されている。一方の導電性針状体9の出没量をそれ程大きく取らなくても良い場合には、コイルばね8の粗巻き部8bの長さを長く確保する必要が無く、本図示例のようにホルダ1を支持体3が1層のみの構造にすることができる。この場合にはホルダ1をより一層薄型化し得る。

【0037】

また、上記各図示例ではコイルばね8の両端に導電性接触手段として一对の導電性針状体9・10を設けた構成にしたが、コイルばね8の配線板11側の導電性接触手段を、図5に示されるようにコイルばね8の対応するコイルエンド(図示例では粗巻き部8bのコイル端)12として、そのコイルエンド12を端子11aに当接させても良い。これによれば、針状体の点数を減らすことができるため、部品点数及び組み立て工数を削減でき、製造コストを低廉化し得る。なお、図5では図4に対応して1層構造のものを示したが、上記複数枚の支持板3・4・5による積層構造であっても良く、同様にコイル端を端子11aに当接させるようにすることができる。

【0038】

このようにして構成された各導電性接触子ユニットにあっては、上記したように組み付け状態でコイルばね8が略無負荷状態であることから、検査対象のチップに応じて、図6に示されるように針状体10の本数が多くかつ密集している場合に有効である。例えば検査対象が半導体パッケージ基板の場合に 1 cm^2 当たり約3000以上のパッド(端子など)が配設されているものがあり、そのような場合には、1本当たりの組み付け状態の荷重が小さくても総荷重は膨大な大きさになり、板状のホルダの場合にはその荷重により反りが生じる虞がある。しかしながら、本構造の導電性接触子ユニットにあっては、組み付け状態の荷重が略無負荷であることから、その総荷重も0か小さいため、上記反りが生じることがない。

【0039】

図7に、本発明の適用外であるが導電性接触子の参考例としての両端可動型の導電性接触子の要部を示す。図示された導電性接触子の接触ユニットは、それぞれ導電性圧縮コイルばね30の両端にそれぞれ導電性針状体29・31を設け両端可動型の導電性接触子であり、それらを支持するホルダが3枚の合成樹脂製支持体28・32・33を積層して形成されている。なお、図に示されるように、上層の支持体28に小径孔を設け、その小径孔により一方の導電性針状体29の針状部が出没自在に支持され、他の各支持体32・33に設けられた大径孔及び連通する段付き孔の大径孔内にコイルばね30が受容され、下層の支持体33の段付き孔の小径孔により他方の導電性針状体31の針状部が出没自在に支持されている。上側の針状体29には、中間層の支持体32の大径孔に受容されるフランジ部が設けられており、そのフランジ部により針状体29が抜け止めされている。

【0040】

図示された組み付け状態に於いて、圧縮コイルばね30は、無負荷状態にある。従って、圧縮コイルばね30は、上下層の支持体28・33に対して互いに離反する向きの力を及ぼすことがない。導電性接触子の両端を、検査対象及び検査装置側配線板に適用すると、圧縮コイルばね30は两部分間にて圧縮され、各接触点に於いて、所要の弾発力が得られる。

【0041】

この参考例によれば、ホルダに加えられる応力が最小化される。また、圧縮コイルばね30を無負荷状態にすることにより、組み付けも簡便化される。接触子の組み付けに際して、支持体28・32・33を積層して固定する前に、圧縮コイルばね30及び両針状体29・31を対応するホルダ孔に挿入する必要がある。圧縮コイルばね30が組み付け時に予圧縮されると、支持体28・32・33は、そのばね力に抗して互いに結合される必要があり、これは組み付けをかなり困難にする。それに対して、本参考例によれば、支持体28・32・33を互いに結合する際にばね力に抗する必要がなく、組み付け作業が単純化される。

10

20

30

40

50

【0042】

上記構造の導電性接触子にあっては、被検査対象と検査装置側配線板との間に設けられて使用される。例えば、図における下層の支持体33の下面に配線板をセットし、上側の針状体29を被検査対象の電極に接触させて検査を行う。

【0043】

このように本発明によれば、コイルばね及び接触手段のホルダへの組み付け状態でコイルばねが略無負荷状態であることから、ホルダ孔により一方の接触手段を抜け止めする場合に、その抜け止め部にコイルばねの圧縮荷重が作用することがない。したがって、ホルダの厚さを薄くしても、従来例で示したような反りやたわみが生じることを回避でき、また熱膨張の小さな絶縁材料である例えばセラミックスを使用することができるため、高温雰囲気（約150度）下で電圧を印加して長時間（数時間～数十時間）テストするバーンインテストを行う導電性接触子の薄型化が可能になり、装置全体のコンパクト化に寄与し得る。また、検査対象が半導体パッケージ基板のように単位面積当たりの導電性接触子の本数が多い（例えば約3000本/cm²以上）場合には、1本当たりの初期荷重が小さくても総荷重は膨大な大きさになり、ホルダに反りが生じる虞があるが、上記したように略無負荷状態にしていることから、そのようなホルダの反りを防止することができる。

10

【0044】

特に、組み付け状態で他方の接触手段の先端がホルダの外面と同一面上に概略位置するようにされていれば、ホルダへの組み付け状態でホルダ外面からの突出量を検査することにより、組み付けの良否を容易に確認することができる。

20

【0045】

また他方の接触手段がコイルばねのコイルエンドであれば、例えば接触手段として針状体を形成し、それをコイルばねと結合する構造とした場合に、片方をコイルエンドで代用することから、部品点数及び組み立て工数を削減でき、製造コストを低廉化し得る。

【0046】

以上、本発明を特定の実施例について説明したが、当業者であれば、請求の範囲に記載された本発明の概念から逸脱することなく、種々の変形・変更が可能である。

【図面の簡単な説明】

【0047】

第1図は、本発明が適用された導電性接触子ユニットに用いられる導電性接触子用ホルダの平面図。

30

第2図は、図1の矢印II-II線に沿って見た断面に対応する導電性接触ユニットの要部縦断面図。

第3図は、コイルばね及び導電性針状体を導電性接触子用支持体に組み付ける要領を示す図。

第4図は、第2の実施の形態を示す図2に対応する図。

第5図は、第3の実施の形態を示す図4に対応する図。

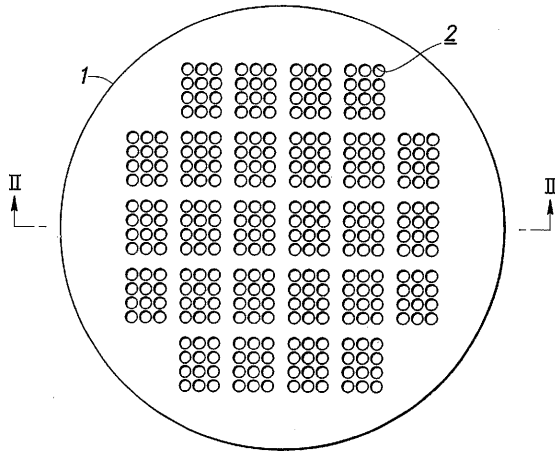
第6図は、針状体が密集して配設された導電性接触子ユニットを示す模式的斜視図（第4の実施の形態）。

第7図は、導電性接触子の参考例を示す要部縦断面図。

40

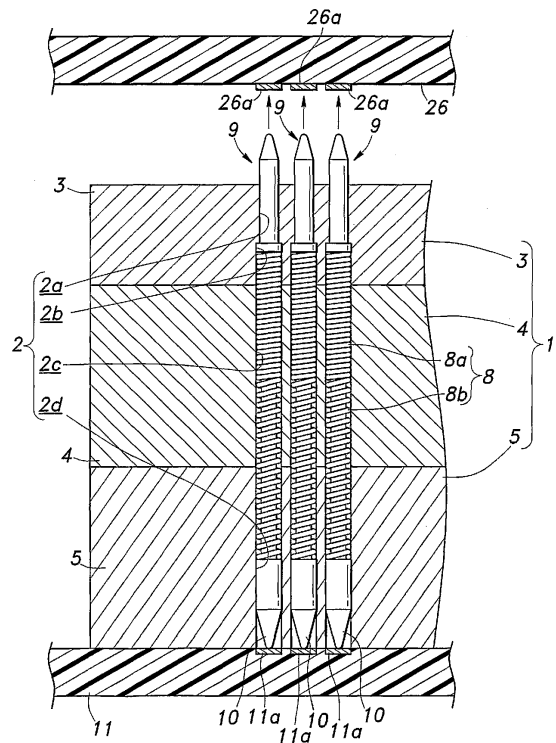
【 図 1 】

Fig.1



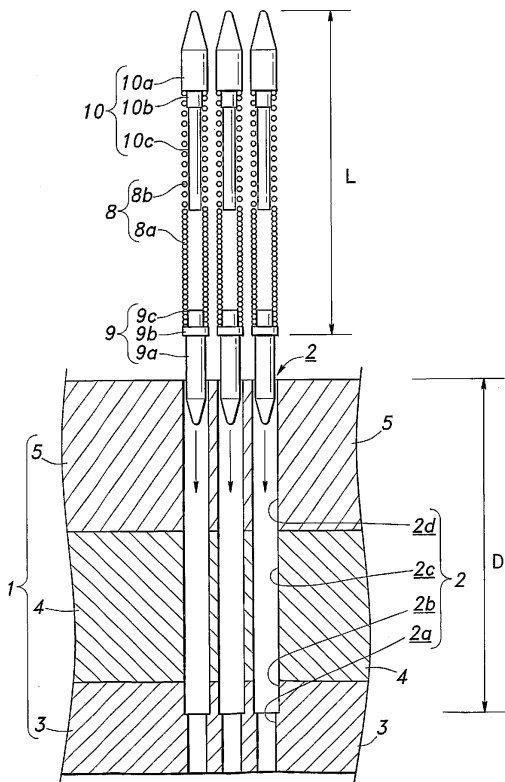
【 図 2 】

Fig.2



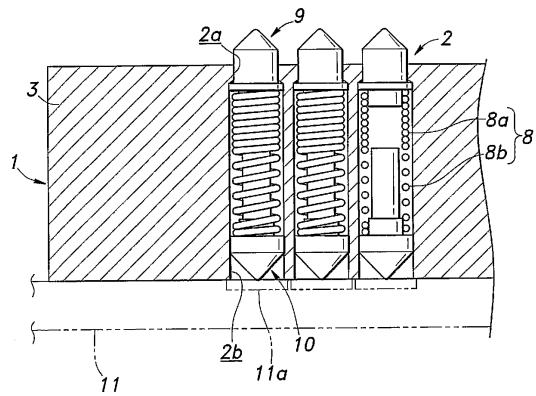
【 図 3 】

Fig.3



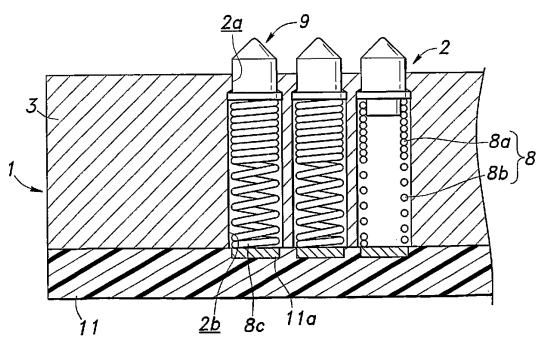
【 図 4 】

Fig.4



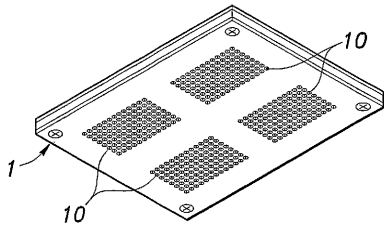
【 図 5 】

Fig.5



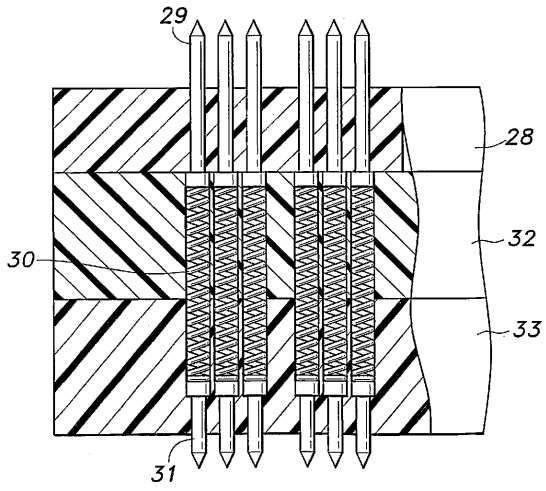
【 図 6 】

Fig.6



【 図 7 】

Fig.7



フロントページの続き

- (56)参考文献 特開平 1 0 - 2 1 4 6 4 9 (J P , A)
特開平 9 - 1 2 1 0 0 7 (J P , A)
特開 2 0 0 0 - 3 2 9 7 9 0 (J P , A)
国際公開第 0 0 / 0 3 2 5 1 (W O , A 1)
国際公開第 0 0 / 0 3 2 5 0 (W O , A 1)
特開 2 0 0 2 - 1 5 8 0 5 3 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G01R 1/073

G01R 31/26